

公開番号 又は 特許番号	WO2012-070490、再表 2012-070490
発明名称	微細孔の製造方法および微細孔を有する基体
出願人 又は 権利者	株式会社フジクラ、国立大学法人東京大学
想定デバイス	バイオ分析チップ、その他
要約	<p>【利用分野】 微細孔を有する基体の製造方法、および微細孔を有する基体に関するもの。</p> <p>【発明の内容】 孔径がナノオーダーの大きさで、且つ、微細な周期構造を備えた微細孔を有する基体の製造方法および前記基体の提供するものであり、基板の内部に対して、パルス時間幅がピコ秒オーダー以下のパルス幅を有するレーザー光を照射し、前記レーザー光が集光した焦点およびその周辺に第一構造改質部を形成し、前記構造改質部に対して熱処理を行い、前記構造改質部の一部において、前記構造改質部が消滅または変性した第二構造改質部を形成し、前記第一構造改質部のうち前記構造改質部を除いた領域に対して選択的にエッチング処理を行い、前記第一構造改質部を除去することによって、微細孔を形成することを特徴とする微細孔の製造方法。</p>
図面	